DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2003 EPO. All rts. reserv.

12681982

1

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 7248507 A2 950926 < No. of Patents: 001>

LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE (English)

Patent Assignee: MATSUSHITA ELECTRONICS CORP

Author (Inventor): EMOTO FUMIAKI; SENDA KOJI; NAKAMURA AKIRA;

ISHIHARA TOMOAKI

IPC: \*G02F-001/136; G02F-001/1333; G02F-001/1335 Derwent WPI Acc No: \*G 95-364221; G 95-364221

Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 7248507 A2 950926 JP 9439761 A 940310 (BASIC)

Priority Data (No,Kind,Date): JP 9439761 A 940310 DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2003 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

\*\*Image available\*\* 04955907

LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

PUB. NO.:

07-248507 [JP 7248507 A]

**PUBLISHED:** 

September 26, 1995 (19950926)

INVENTOR(s): EMOTO FUMIAKI

SENDA KOJI

NAKAMURA AKIRA ISHIHARA TOMOAKI

APPLICANT(s): MATSUSHITA ELECTRON CORP [000584] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.:

06-039761 [JP 9439761]

FILED:

O

March 10, 1994 (19940310)

INTL CLASS:

[6] G02F-001/136; G02F-001/1333; G02F-001/1335

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment)

JAPIO KEYWORD:R011 (LIQUID CRYSTALS)

### **ABSTRACT**

PURPOSE: To increase the opening allowing light to transmit of an active matrix type liquid crystal display device and to facilitate aligning at the time of sticking the substrates to each other.

CONSTITUTION: Electrode wirings 1, 7a to be drawn out of sources 5 and drains 7 of thin-film transistors 4 formed on a first substrate 9 are formed into two layers. Light shielding films 18 are formed out of the same material as the material of the electrode wirings (connecting electrodes) 7a of the second layer. Pixel electrodes 8 are formed on the inter-layer insulating films 10c formed on the light shielding films 18. The light shielding films 18 are formed on the same substrate by the stages for producing the thin-film transistors 4 and, therefore, the light shielding films 18 which are heretofore formed large by taking the aligning accuracy into consideration can be eventually formed in the smallest necessary size.

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出屬公開番号

特開平7-248507

(43)公開日 平成7年(1995)9月26日

(51) Int.CL.*		識別記号	庁内整理番号	ΡI	技術表示箇所
G02F	1/136	500			
	1/1333	505			
	1/1335	50 <b>0</b>			

# 審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 4 頁)

(21)出願書号	特顯平6-39761	(71) 出職人 000005843
		松下電子工業株式会社
(22)出票日	平成6年(1994)3月10日	大阪府高槻市串町1番1号
		(72)発明者 江本 文昭
		大阪府高橋市幸町1番1号 松下電子工業
		株式会社内
		(72)発明者 千田 耕司
		大阪府高槻市幸町1番1号 松下電子工業
		株式会社内
		(72)発明者 中村 晃
		大阪府高槻市幸町1番1号 松下電子工業
		株式会社内
		(74)代理人 弁理士 小観治 明 (外2名)
		最終質に続く

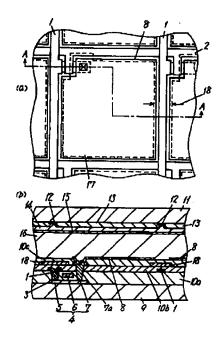
## (54) 【発明の名称】 核晶表示装置

### (57)【要約】

【目的】 アクティブマトリックス型液晶表示装置において、光が透過する開口を大きくし、かつ基板同士を貼り合わせるときの位置合わせを容易にする。

【構成】 第1の基板9の上に形成された薄膜トランジスタ4のソース5、ドレイン7から引き出す電極配線1、7aを2層にし、第2層の電極配線(接続電極)7aと同一材料で遮光膜18を形成し、その遮光膜18の上に形成された層間絶縁膜10cの上に囲素電極8を形成している。

【効果】 遮光膜18が薄膜トランジスタ4の製造工程で同一基板上に形成されるため、従来は位置合わせ精度を考慮して大きく作っていた遮光膜18を最小限の大きさで作ればよいことになる。



(2)

1

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 薄膜トランジスタがマトリックス状に形 成された第1の基板と、色フィルタおよび対向電極が形 成された第2の基板とを対向保持してなる液晶表示装置 であって、前記薄膜トランジスタを覆って前配第1の基 板上には第1の層間絶縁膜が形成されており、前記第1 の層間絶縁膜の上に前記薄膜トランジスタのソースに接 続された信号線が形成されており、前配信号線を覆って 第1の層間絶縁膜の上に第2の層間絶縁膜が形成されて おり、前記第2の層間絶縁燵の上に前記薄膜トランジス 10 る遮光膜、13は色フィルタ、14はフィルタ保護膜、 タのドレインに接続され画素電極とドレインとを接続す るための接続電極および格子状の遮光膜が形成されてお り、前記接続電極および進光膜を覆って第3の層間絶縁 膜が形成されており、かつ前記第3の層間絶縁膜の上に 前記格子状の遮光膜と周辺部で重なりをもって前記接続 電極に接続された國素電極が形成されている液晶表示装

【請求項2】 接続電極および遮光膜がアルミニウムを 主成分とする金属薄膜で構成されている請求項1記載の 液晶表示装置。

【請求項3】 薄膜トランジスタのドレインと接続電極 の間に相互の反応を防止するバリヤメタル層を挿入して なる請求項2記載の液晶表示装置。

【請求項4】 接続電極がパリヤメタル層とその上に形 成されたアルミニウムを主成分とする金属薄膜からな り、遮光膜がバリヤメタル層からなる請求項1記載の液 晶表示装置。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、薄膜トランジスタが形 30 成された基板と対向電極が形成された基板とで液晶を挟 持してなる液晶表示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、絶縁基板上にアモルファスシリコ ン膜または多結晶シリコン膜を形成し、それらの膜を活 性領域として使用する薄膜トランジスタの構造および製 造方法が進展し、アクティブマトリックス型の液晶表示 装置などが実用化されている。

【0003】液晶表示装置では基板の裏面または表面か いるために、不要な光を極力遮光しなければならない。 不要な光の一つは薄膜トランジスタに入射する光、もう 一つは制御できない領域を通過する光である。前者は薄 膜トランジスタの動作異常を、後者はコントラスト低下 を引き起とす原因となる。とのような不要な光が液晶表 示装置に入射することを防止するために、従来から種々 の方法が開発されている。

【0004】以下に従来の液晶表示装置について説明す る。図2 (a)は従来の液晶表示装置で画素トランジス タが形成された基板の平面図、図2(b)は同液晶表示 50 画素電極8とを接続する接続電極、10aは第1の層間

装置をA-A線で切断した断面図である。これらの図に おいて、1は信号線、2は走査線、3は多結晶シリコン 膜、4は画素トランジスタ、5は画素トランジスタ4の ソース(信号線1に接続)、6は画素トランジスタ4の ゲート(走査線2に接続)、7は画素トランジスタ4の ドレイン (後述の画素電極に接続)、8は透明導電膜で 形成された画素電極、9は第1の基板、10は層間絶縁 膜、11は第2の基板、12aは画素トランジスタ4を 遊光する遮光膜、12bは画素電極8の周辺部を遮光す 15は対向電極、18は液晶である。なお第1の基板 9、第2の基板11のそれぞれ最上層に形成される配向

膜は図示していない。 【0005】従来の液晶表示装置では、図2(b)に示 すように、 画素トランジスタ4に入射する不要光を遮光 する膜は、第2の基板11側にクロム蒸着膜または色フ

180001

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記の従 20 来の構成では、第1の基板と第2の基板とを位置合わせ する際の位置合わせ精度を考慮しなければならないため に、遮光膜12a、12bの寸法に余裕をもたせて大き くしており、期口17が小さくなるという課題を有して

ィルタ13を3色重ねた不透明膜で形成されていた。

【0007】本発明は上記従来の課題を解決するもの で、従来に比べて光が透過する開口を大きくできるとと もに、基板を貼り合わせるときの位置合わせが容易とな る液晶表示装置を提供することを目的とする。

[8000]

【課題を解決するための手段】この目的を達成するため に本発明の液晶表示装置は、画素トランジスタのドレイ ンと画素電極とが中間に接続電極を介して接続されてお り、かつ進光膜が前記接続電極と同一膜で形成されてい る構成を有している。

[0000]

【作用】この構成によって、画素トランジスタが形成さ れた基板側に遮光膜が直接形成されるため、画素トラン ジスタと遮光膜との合わせ精度がよくなり、基板貼り合 わせ工程で要求される精度が緩くなる。その結果、従来 5光を照射し、その光を液晶シャッタを用いて制御して 40 は合わせ精度も考慮して大きくとっていた遮光膜パター ンが小さくなり、開口が大きくなる。

[0010]

【実施例】以下本発明の一実施例について、図面を参照 しながら説明する。

【0011】図1(a)は本発明の一実施例における液 晶表示装置の平面図、図1(b)は同液晶表示装置をA - A線で切断した断面図である。図1において、図2に 示す従来例と同一箇所には同一符号を付して説明を省略 する。なお、7aは薄膜トランジスタ4のドレイン7と

(3)

絶縁膜、106は第2の層間絶縁膜、10cは第3の層 間絶縁膜、18は第1の基板9上に設けられた遮光膜で

【0012】本実施例では矢印で挟んだ領域が遮光膜1 8を示しており、図1(a)に示すように、開口17以 外の領域は全て遮光膜18で覆われている。またその断 面構造は図1(b)に示すように、第1の基板9の上に 画素トランジスタ4が形成されており、第1の層間絶縁 膜lOaのコンタクトホールを通して薄膜トランジスタ 4のソース5に導通する信号線1がアルミニウムを主成 10 分とする蒸着膜で形成されている。その上には第2の層 間絶縁膜10bが形成されており、第1の層間絶縁膜1 0 a および第2の層間絶縁膜10bのコンタクトホール を通して薄膜トランジスタ4のドレイン7に導通する接 統電極7 aが形成されている。また第2の層間絶縁膜1 0 b の上には遮光膜 1 8 が形成されており、その上には 第3の層間絶縁膜10cが形成されている。この第3の 層間絶縁膜10cの上には画素電極8が形成されている が、この画素電極8と接続電極7aとは第3の層間絶縁 膜10cに設けられたコンタクトホールを介して接続さ 20 置で画素トランジスタが形成された基板の平面図 れる。また画素電極8は遮光膜18と一部オーバーラッ ブして形成されている。

【0013】また本実施例においては、画業トランジス タ4と画素電極8とを例えばアルミニウムを主成分とす る接続電極7aを介して接続しているが、さらに、接続 電極7aとドレイン7との間または接続電極7aと画素 電極8との間に相互の反応を防止するパリヤメタル層を 介在させることにより、いっそう画素電極8とドレイン 7とのコンタクトを安定させることができる。また本実 施例においては、遮光膜18を接続電極7aと同一材料 30 7a 接続電極 で構成しているが、接続電極了aとドレイン?との間ま たは接続電極7aと画素電極8との間に挿入するパリヤ メタル層を例えばタングステンやチタンのシリサイド膜 またはチタンの窒化膜などの不透明金属材料で構成し、 それと同一材料で遮光膜18を構成してもよいし、さら にはパリヤメタル層と接続電極7aとの2層構造として もよい.

【0014】とのような構成とすることにより、第2の 基板 1 1 側に遮光膜を必要とせず、そのために遮光膜 1

8と画素トランジスタ4との高精度の位置合わせが不要 となり、遮光膜18の形状を従来の構成に比べて小さく することができる。したがって、開口17を大きくとる ことができ、また明るさが同じでよければ、従来の構成 に比べて画素数を増やすことができる。

### [0015]

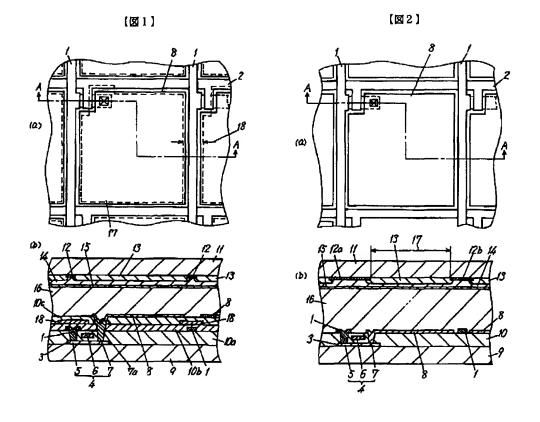
【発明の効果】本発明は、薄膜トランジスタのソース、 ドレインから引き出す電極配線を2層にし、第2層の電 極配線と同一材料で遮光膜を形成し、その遮光膜の上に 形成された層間絶縁膜上に画素電極を形成した構成を有 しており、薄膜トランジスタと遮光膜の合わせ精度が高 く、かつ遮光膜を位置合わせ精度を考慮することなく最 小限度で作ればよいため関口を大きくとれる優れた液晶 表示装置を実現できるものである。またとのような構成 を採用することにより、同じ明るさであれば、従来の液 晶表示装置より微細化でき、その結果、画素数を増やす ことができる。

#### 【図面の簡単な説明】

- 【図1】(a)は本発明の一実施例における液晶表示装
- (b)は同液晶表示装置をA-A線で切断した断面図 【図2】(a)は従来の液晶表示装置で画素トランジス タが形成された基板の平面図
- (b)は同液晶表示装置をA-A線で切断した断面図 【符号の説明】
- 1 信号線
- 5 ソース
- ドレイン
- - 8 画素電板
  - 9 第1の基板
  - 10a 第1の層間絶縁膜
  - 10b 第2の層間絶縁膝
  - 10 c 第3の層間絶縁膜
  - 11 第2の基板
  - 13 色フィルタ
  - 15 対向電極
  - 18 遮光膜

特開平7-248507

(4)



フロントページの続き

(72)発明者 石原 知明 大阪府高槻市幸町 1 番 1 号 松下電子工業 株式会社内